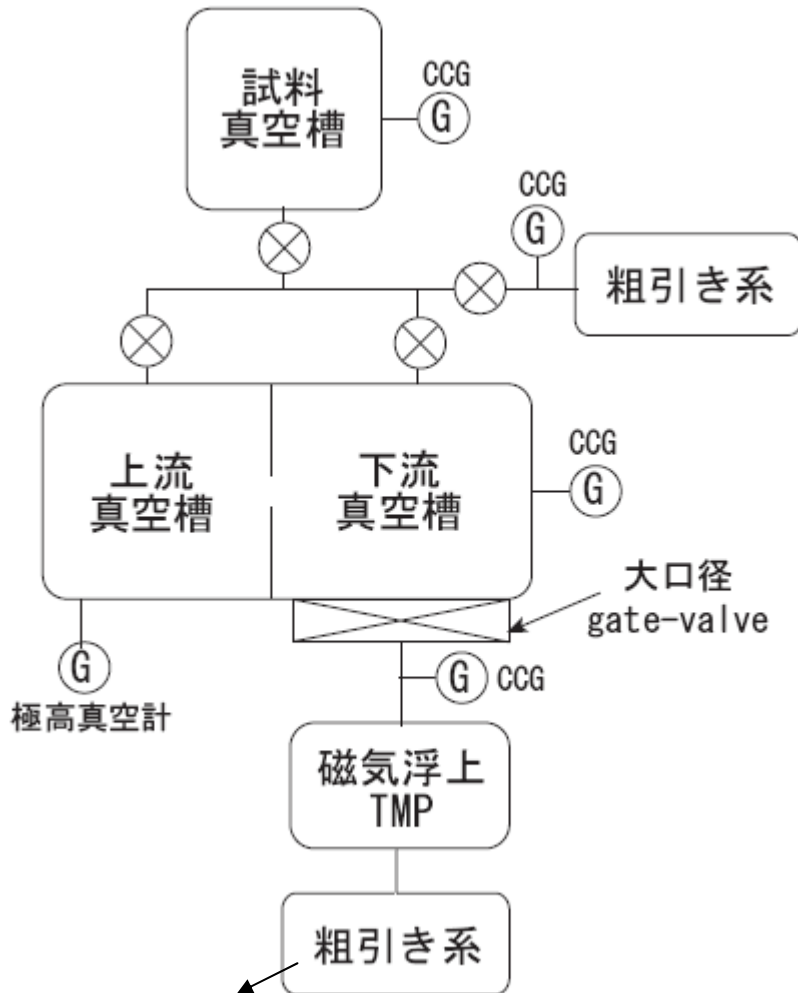




真空試験装置に関して

- 8月4日 山口大学 栗巢氏の研究室訪問
 - ガス放出速度測定装置見学
 - 具体的な装置のサイズや構成、装置の操作などの確認
 - 意見交換
 - セラミックのガス放出速度の測定について
- (同日) 新光産業 Tiチェンバー製作現場訪問
 - 工作技術や環境・規模の確認
 - 担当者の方との意見交換
 - 機械加工や溶接・ロウ付け、工作可能サイズの確認
 - リークチェックや表面処理・加熱処理などの確認

真空試験装置：0次案



名古屋大で予備に保管
していたものが故障

- 装置操作時のトラブル回避のために各所に真空計(CCGなど)を接続。
- 測定時間の短縮化
- 上流槽の排気方法は？
- 試料および試料真空槽の大きさは？
- ベーキング方法は？

山口大学の試験装置仕様

- ・オリフィス直径 5.4mm
- ・上流側内面積 $165 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- ・下流側内面積 $210 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
- ・主排気ポンプ(磁気浮上TMP) 550 l/s,
粗引き系 TMP:150 l/s, RP:150 l/min
- ・真空計 電離真空計(上流・下流)
- ベーク 160 48時間、ベーク終了後48時間
- ・上流真空槽 $1.6 \times 10^{-8} \text{ Pa}$
- ・下流真空槽 $6.5 \times 10^{-9} \text{ Pa}$
- ベークなし主排気ポンプ起動後48時間
- ・上流真空槽 $4.6 \times 10^{-7} \text{ Pa}$
- ・下流真空槽 $3.9 \times 10^{-8} \text{ Pa}$